

100 nm 空間分解能 フルカラー 光学顕微鏡

超解像イメージング顕微鏡

NANORO



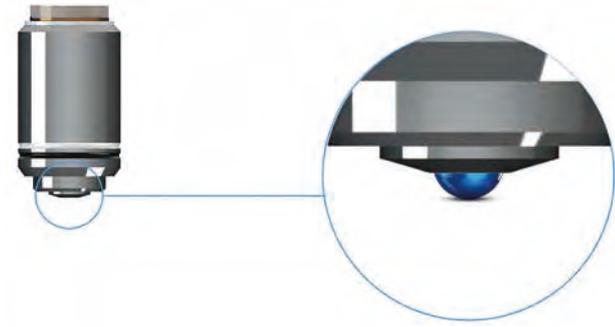
測定例：CMOS センサー カラーフィルター



※1ピクセル 1.14 μm 四方

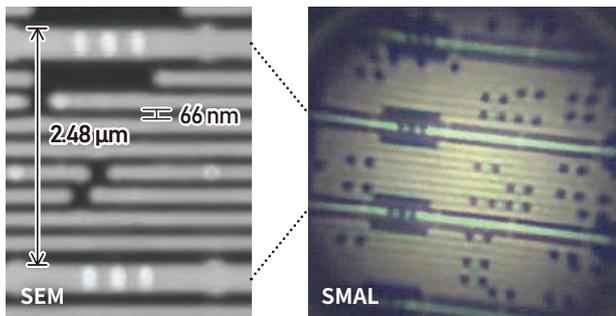
超解像度を実現する対物レンズ

SMAL Super-resolution Microsphere Amplifying Lens



- 近接場光を制御するマイクロスフィアを搭載
- 回折限界を超える分解能

100 nm の空間分解能

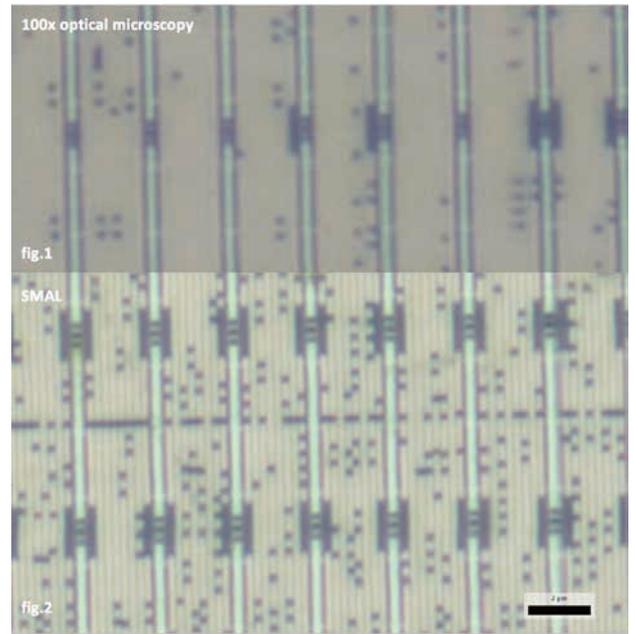


マイクロプロセッサ (CPU) の 66 nm のラインを検出

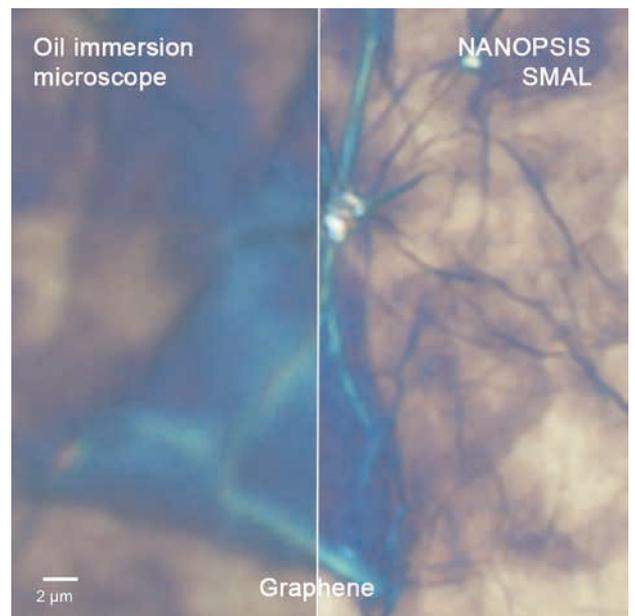
仕様

対物レンズ	SMAL (水浸 / 油浸, 作動距離: 1-3 μm), 100x, 40x, 10x
カメラ	12 MP CMOS
XYステージ	移動範囲: 50×50 mm
Zステージ	移動範囲: 60 mm

測定例: マイクロプロセッサ (CPU)



測定例: グラフェン



東京インスツルメンツ
TOKYO INSTRUMENTS

本社: 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西 6-18-14 T.I.ビル ☎03-3686-4711
 大阪営業所: 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 4-1-46 新大阪北ビル ☎06-6393-7411
 ☎ <https://www.tokyoinst.co.jp> ✉ sales@tokyoinst.co.jp

TII Group Company - グローバルにネットワークを広げ、最先端の科学をお客様に提供 -

株式会社ユニソク

日本 / 超高真空・極低温走査型プローブ顕微鏡、
高速分光測定装置、クライオスタット



LOTIS TII

ペラルーシ / レーザー、
レーザーマーキングシステム、光学部品製造



SPECS-TII

中国、スイス、ロシア、アメリカ /
Enviro ESCA (準大気圧 XPS)、ARPES など



- 本カタログに記載されている内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。(製品の仕様、性能、価格などはカタログ発行当時のものです)
- 本カタログに記載されている内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- 本カタログに記載されているメーカー名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

No.C-LIG01-4002A.20210527